



VE-2050

真空蒸着装置

TMP 排気・清浄真空



一步進んだ
装置で、
二歩進む
研究を！

一步進んだ試料作りは清浄高真空から始まります。

- ◆ ターボモレキュラーポンプ(TMP)排気系を採用した清浄高真空蒸着装置です。
- ◆ 高真空は膜純度の向上、膜密度の向上に貢献します。
- ◆ タッチパネルの EVAC START のボタンを押せば予備排気から高真空排気まで自動的に行います。
- ◆ タッチパネル+プログラム制御で操作ミスを防止する安全設計です。
- ◆ VE-2050 には多彩な付属装置(オプション)が用意してあります。
- ◆ 研究の目的に対応した機能の追加改造もお受けします。

取扱店

製造元

株式会社 真空デバイス

〒311-4155 茨城県水戸市飯島町 1285-5

Tel:029-212-7600 Fax: 029-212-7601

E-mail: device@shinkuu.co.jp

特徴・仕様

特徴

- ◆ 真空排気系は冷却水不要の TMP+RP と全電磁バルブよりなる全自動排気系です。
- ◆ タッチパネル操作で誤った手順で操作が出来ない安全機能搭載。
- ◆ TEM や SEM の絞り類のベーキングも短時間で完了し、時間の節約になります。
- ◆ メタルコーティングやシャドーイングは超微粒子蒸着となり解像度が向上します。
- ◆ カーボンコーティングも丈夫で緻密な蒸着膜になります。カーボン補強や支持膜作成に効果を発揮します。
- ◆ 停電時は全バルブが自動で閉じ、真空が保持されます。ロータリポンプのみ自動的にエアリークされます。停電が回復したら初期画面に戻ります。
- ◆ 入力スイッチはサーキットプロテクタです。装置内で過電流が発生すると自動的に OFF になります。

仕様

1. 真空槽：内径 200mm×高さ 248mm、ICF70 サービスポート。
2. 試料ステージ：直径 58mm 水平試料台(標準装着)。モーター駆動、回転・傾斜試料台はオプション。
3. 加熱用電極柱：2 対 4 本、スイッチ切り換えにより選択使用。柱は着脱自由。
絞り焼きポート支持電極 1 対標準付属。 タングステンバスケットによる金属蒸着が可能。
チャンバー大気解放時、電極間は通電しません。
4. ヒータ電源：最大電流 80A(標準ポート使用時)、電流計指示。
5. 蒸着可能面積：柱利用、上からの蒸着時 = 直径 90mm 以内。下からの蒸着時 = 直径 180mm 程度まで。
6. 真空排気系統：TMP(67L/sec) + ロータリポンプ(50L/min)。
7. 真空度測定：フルレンジ真空計(標準装備)。
8. 到達真空度： 5×10^{-4} Pa 以下。
9. 安全対策：停電時/全電磁バルブ閉、PR にエアリーク。
停電回復時/真空システムは停止状態を保持。初期の状態で復帰。
回路内過電流対策/15A 超でサーキットプロテクタ作動、入力断。PR 回路、真空排気系統、電極柱系電源回路別に
サーキットプロテクタ採用。加熱電流用 80A のヒューズ。
10. 入力電源：AC100V 15A(単相)。
11. 装置サイズ：幅 534mm×奥行き 675mm×高さ 1134.5mm。重量=80kg(2 輪ストッパー付キャスター装備)。

オプション

- ◆ CE-01 形クランプ電極銃：SLC-30 形カーボン専用のカーボン蒸着電極です。
ベルジャー内の汚れを最小限にするカバー付属。
- ◆ モーター駆動ジンバル試料台：SEM 試料のメタルコーティングに使用します。
- ◆ 電子銃加熱蒸着ユニット：抵抗加熱式で蒸着困難な材料を蒸着する事が可能になります。
- ◆ 加熱試料台：500°Cまで加熱・温調できる試料台です(本体への改造が必要です)。
- ◆ 膜厚モニター：水晶発振式膜厚測定装置が装着できます(水冷循環装置も同時にご購入下さい)。
- ◆ ロングベルジャー・ICF ポート追加・基板ホルダ・2 源蒸着電極・電源 BOX など。
- ◆ スクロールポンプへ変更。

その他、多様なオプションに対応いたします。

*** 詳細に関するお問い合わせは代理店または営業担当までお問い合わせ下さい。**



本カタログ記載内容は、改良に伴い予告なしに変更する場合があります。

ご了承ください。